LANTO® 朗拓科技

超高纯度气体输送设备

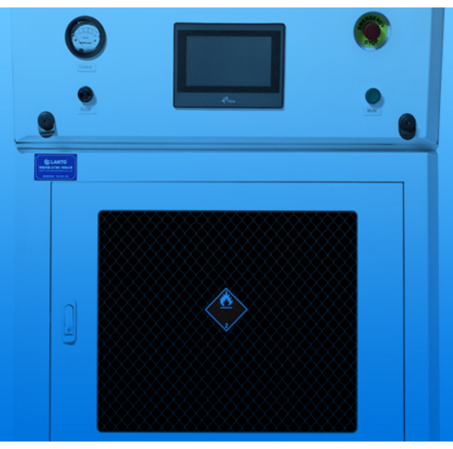
Ultra High Purity Gas Delivery Equipment



www.lantolab.com

LANTO® 朗拓科技

特气柜系统
Specialty Gas Cabinet System



特点 Features

特气柜系统是一种用于安全存储特种气体钢瓶，并将适当体积和压力的特种气体输送到分配系统（VMB 和 VMP）或主设备（POU、使用点）。其高度灵活性以及多种连接选项，使其广泛应用于半导体、平板显示（FPD）、LED、新材料、太阳能电池制造工艺的系统。

技术参数 Technical Parameter

- 规格：单瓶、双瓶、三瓶
- 控制：全自动、半自动、手动
- 尺寸：W550mm*D585mm*H2030mm
  W800mm*D585mm*H2030mm
  W1200mm*D585mm*H2030mm
- 电源：110-220 VAC、50-60 HZ、Single Phase
- 功率：1 KW（2.5 KW带加热）
- 气动压力：0.4-0.6 MPa CDA or N_2
- 排风管尺寸：4寸（100 mm）

标准配置（全自动） Standard Configuration

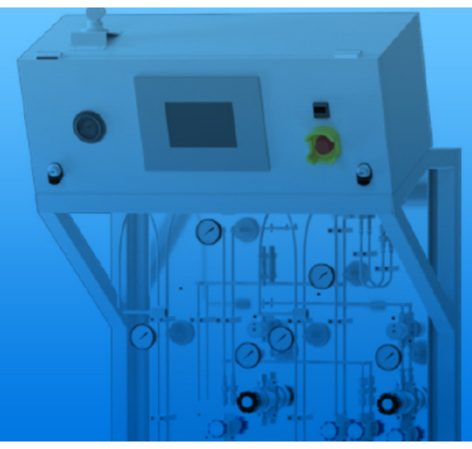
- PLC触摸屏控制
- 自动吹扫置换
- 阀门状态显示
- 高低压排空，自动抽真空
- 防爆可视窗
- 消防喷淋、抽风口风阀
- 自动切换
- 紧急切断，可接远程控制
- 自动保压检漏
- 0.003 μm过滤器
- 声光报警

可选配置 Optional Configuration

- 钢瓶切断阀
- 电子秤
- UV/LR 探头
- 气体泄漏探头
- 烟感探头
- 管道加热
- 加热毯
- 高温探头
- 加热控制箱
- 防爆装置
- 过流开关
- 门控
- 其他需求

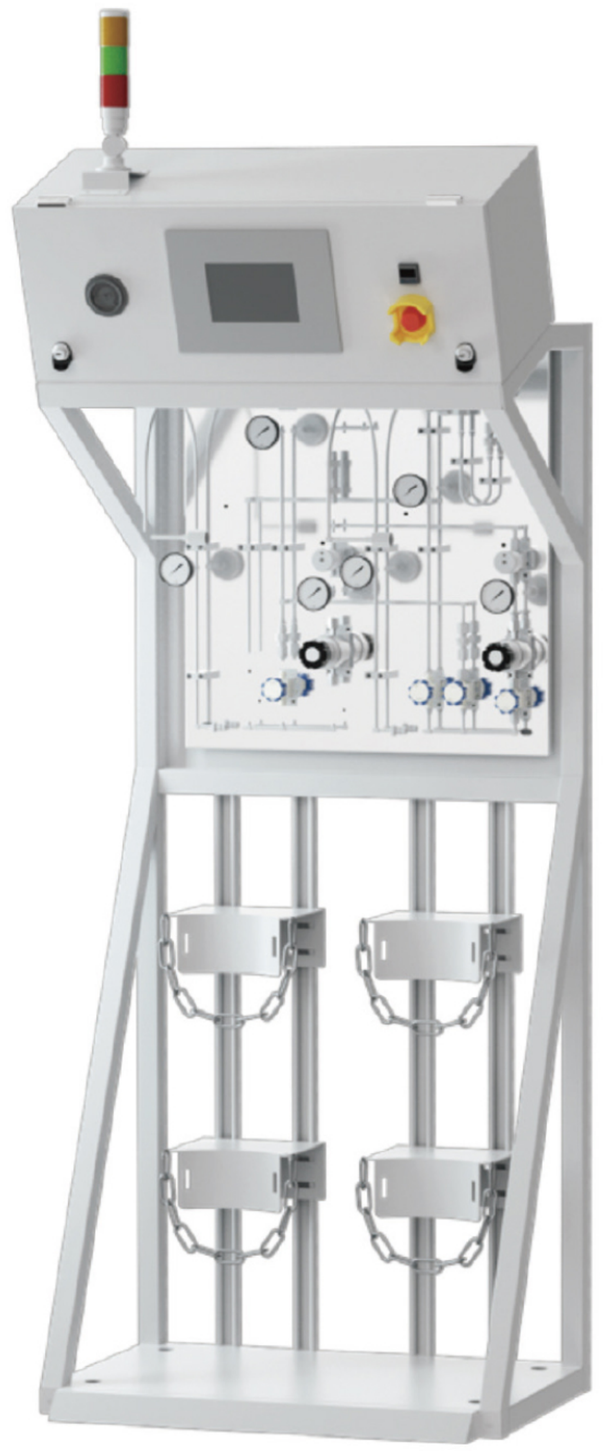
LANTO® 朗拓科技

特气架
Gas Rack



特点 Features

GR特气架（Gas Rack）是专为半导体生产、光伏、生物医药等高纯气体供应系统设计的设备，主要用于实现气瓶与工艺设备之间的气体输送中转。特气架的主要功能是安全存储气体钢瓶，并通过内置的气路系统将气体输送到使用点，同时具备吹扫、抽真空、排气等功能，确保气体供应的纯净度和安全性。特气架的设计通常包括气瓶固定装置、气路控制系统、压力表等部件，以满足不同气体的存储和使用需求。



技术参数 Technical Parameter

- **规格：** 单瓶、双瓶
- **控制：** 半自动、手动
- **尺寸：** W550mm*D500mm*H2030mm
  W800mm*D500mm*H2030mm
- **气动压力：** 0.4-0.6 MPa CDA or N_2

标准配置（半自动） Standard Configuration

- PLC触摸屏控制
- 手动吹扫
- 阀门状态显示
- 高低压排空
- 0.003 μm过滤器
- 自动切换
- 紧急切断，可接远程控制
- 自动保压检漏
- 声光报警

可选配置 Optional Configuration

- 钢瓶切断阀
- 电子秤
- 气体泄漏探头
- 管道加热
- 加热毯
- 加热控制箱
- 其他需求

LANTO® 朗拓科技

超高纯阀门分配箱/阀门分配盘
Valve Manifold Box/Valve Manifold Panel



特点 Features

LANTO阀门分配箱为气体系统提供安全可靠的分配点。VMB：采用全封闭箱体结构，配备排风设施（如抽风管）以维持柜内负压，有效防止气体泄漏扩散，适用于高危险性环境。专用于输送有毒、易燃易爆或腐蚀性气体（如SiH_4、Cl_2、NH_3）。VMP：为开放式面板或盘面设计，无外壳密封，结构更紧凑。适用于惰性气体（如N_2、Ar）或非危害性气体。



技术参数 Technical Parameter

- **规格：** 1-8路
- **控制：** 全自动、半自动、手动
- **电源：** 110-220 VAC、50-60 HZ、Single Phase
- **功率：** 1 KW （2.5 KW带加热）
- **气动压力：** 0.4-0.6 MPa CDA or N_2
- **排风管尺寸：** 4寸 （100 mm）

标准配置（全自动） Standard Configuration

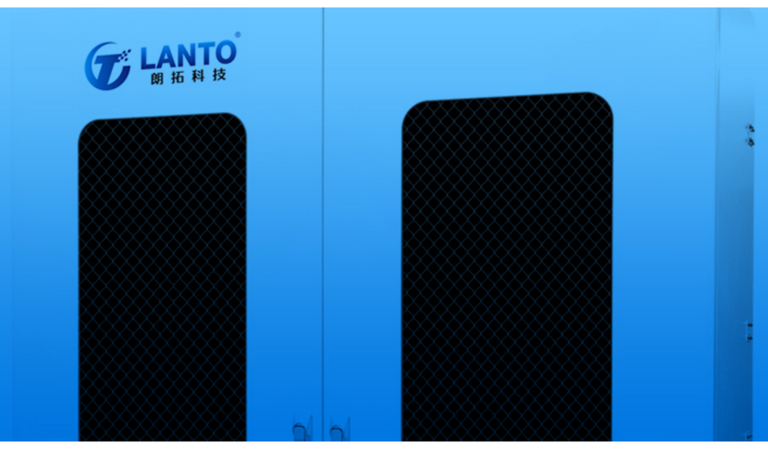
- PLC控制
- 紧急切断，可接远程控制
- 高低压排空，自动抽真空
- 防爆可视窗
- 自动吹扫置换
- 阀门状态显示
- 0.003 μm过滤器

可选配置 Optional Configuration

- 盘面加热
- UV/LR 探头
- 气体泄漏探头
- 高温探头
- 门控
- 其他需求

LANTO® 朗拓科技

配气柜
Gas Box



特点 Features

配气柜（Gas Box）是半导体工艺设备的核心子系统，也是半导体供气系统关键组成部分，其核心功能在于实现工艺气体的精密控制与安全防护。配气柜通过集成截止阀（手动/气动）、逆止阀、质量流量控制器（MFC）、压力调节控制器、高精密过滤器及特殊密封组件，构建起多重安全保障体系。在工艺执行中，该系统可精准调控气体流量、压力、浓度、混合比例及反应时间等关键参数，同时满足半导体制造对超净环境、材料耐蚀性和介质安全性的严苛要求，有效防范毒性/可燃气体泄漏风险。



可选择的项目 Optional Items

- 客制化需求设计
- 工艺气体纯化及过滤
- 吹扫置换系统
- 气体泄漏检测
- 流量及压力控制

应用及标准 Application and Standards

为泛半导体行业客户提供工艺设备或子系统Gas Box的OEM或ODM服务。高标准洁净厂房，全自动焊接设备，精密检测仪器，完善的质量保证体系，实现高精度制造。

LANTO® 朗拓科技

联系我们

Contact Us

朗拓科技（广州）有限公司

LANTO TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD

广州市增城区荔新十二路14号景顺产业园1栋

热　线：　廖工　186-6465-1481（微信同号）

官网：www.lantolab.com

邮箱：service@lantolab.com